



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: KDHJ252106

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	无锡华润上华科技有限公司

江苏康达检测技术股份有限公司
KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	无锡华润上华科技有限公司		
通讯地址	江苏省无锡市新吴区锡士路		
联系人	高扬	联系电话	13961774334
采样日期	2025-05-08~2025-05-09	分析日期	2025-05-08~2025-05-12
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结论	检测结果见表1。		
<div>编制：丁玉清</div> <div>审核：黄凯华</div> <div>签发：邵娇娇</div> <div>检测机构检验章</div> <div>签发日期：2025 年 05 月 19 日</div> <div></div>			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表（5 月 8 日）

点位名称		FQ-005 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		24.6	23.8	24.2	24.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		12681	12971	12957	12870	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表（5 月 8 日）

点位名称		FQ-006 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		25.1	24.3	23.8	24.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		12159	12444	12720	12441	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-3 固定污染源废气检测结果表（5 月 8 日）

点位名称		FQ-011 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		27.8	26.8	26.2	26.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		12797	12842	12104	12581	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	2.67	ND	0.97	10
	排放速率（kg/h）	0.012				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-4 固定污染源废气检测结果表（5 月 8 日）

点位名称		FQ-016 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.1	20.0	19.8	20.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		21256	21590	21861	21569	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-5 固定污染源废气检测结果表（5 月 8 日）

点位名称		FQ-017 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.2	19.0	19.1	19.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		22937	23470	22431	22946	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-6 固定污染源废气检测结果表（5 月 8 日）

点位名称		FQ-051 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		活性炭吸附				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		24.5	24.4	24.9	24.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		2675	2666	2808	2716	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-7 固定污染源废气检测结果表（5 月 8 日）

点位名称		FQ-051 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		活性炭吸附				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	最大值	排放限值
烟气温度（℃）		24.7	24.0	24.9	/	/
标态烟气量（Nm³/h）		2702	2734	2808	/	/
硫化氢	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
	排放量（kg/h）	/	/	/	/	1.8
臭气浓度	无量纲	26	35	30	35	15000
备注	1、排放限值：《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 限值。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.008mg/m³（采样体积以 9L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-8 固定污染源废气检测结果表（5 月 8 日）

点位名称		FQ-049 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.5	23.8	23.6	23.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		2184	2135	2188	2169	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.61	0.60	1.04	0.75	10
	排放速率（kg/h）	1.6×10 ⁻³				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-9 固定污染源废气检测结果表（5 月 8 日）

点位名称		FQ-050 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		24.8	24.6	25.1	24.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		1148	1279	1054	1160	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-10 固定污染源废气检测结果表（5 月 8 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.1	19.1	19.1	19.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		51045	52054	53480	52193	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-11 固定污染源废气检测结果表（5 月 8 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.0	18.9	18.6	18.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		52871	52147	51792	52270	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.39	2.11	1.00	1.17	10
	排放速率（kg/h）	0.061				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-12 固定污染源废气检测结果表（5 月 8 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.1	19.1	18.6	18.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		51045	53480	51792	52106	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-13 固定污染源废气检测结果表（5 月 8 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.8	19.1	18.8	18.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		41723	42273	42447	42148	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	0.61	3.81	0.22	1.55	10
	排放速率（kg/h）	0.065				/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-14 固定污染源废气检测结果表（5 月 8 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.8	18.8	18.5	18.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		42216	42076	41474	41922	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-15 固定污染源废气检测结果表（5 月 8 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.8	18.8	18.5	18.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		41723	42447	41474	41881	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-16 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-021 废气排气筒		排气筒高度（m）		25
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.2	20.8	20.9	21.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		7211	7420	7255	7295	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.83	0.81	2.57	1.40	10
	排放速率（kg/h）	0.010				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-17 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-026 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.2	19.9	20.7	20.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		31562	32014	32934	32170	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	1.10	0.97	1.28	1.12	10
	排放速率（kg/h）	0.036				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-18 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-026 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.6	21.0	21.5	20.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		31787	31960	31969	31905	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-19 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-026 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.2	20.7	21.0	20.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		31562	32934	31960	32152	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-20 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.0	17.0	17.0	17.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		46157	44539	44465	45054	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	0.25	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-21 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.0	16.8	16.6	16.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		44678	44478	44412	44523	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	4.63	0.93	0.66	2.07	10
	排放速率（kg/h）	0.092				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-22 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.0	17.0	16.6	16.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		46157	44678	44412	45082	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-23 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.5	19.6	19.6	19.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		34280	35441	35497	35073	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	0.58	0.56	1.18	0.77	10
	排放速率（kg/h）	0.027				/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-24 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.1	19.1	19.1	19.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		33014	32881	32797	32897	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-25 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.5	19.1	19.1	19.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		34280	33014	32797	33364	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-26 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.4	18.6	18.6	18.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		31649	31420	31992	31687	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	0.88	1.62	2.88	1.79	10
	排放速率（kg/h）	0.057				/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-27 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.6	18.6	18.5	18.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		32003	32150	32169	32107	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-28 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.4	18.6	18.5	18.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		31649	32003	32169	31940	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-29 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.9	19.2	19.1	19.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		36175	36827	35439	36147	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	4.41	1.88	2.37	2.89	10
	排放速率（kg/h）	0.10				/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-30 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.9	18.9	19.0	18.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		35297	35511	35429	35412	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-31 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.9	19.1	19.0	19.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		36175	35439	35429	35681	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-32 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		14.0	14.4	14.3	14.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		28872	29539	29769	29393	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-33 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		13.9	13.9	13.9	13.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		27708	27630	27678	27672	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	1.28	6.23	1.31	2.94	10
	排放速率（kg/h）	0.081				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-34 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		14.0	14.3	13.9	14.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		28872	29769	27678	28773	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-35 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.5	19.7	19.6	19.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		27537	27456	28123	27705	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	1.55	1.15	1.52	1.41	10
	排放速率（kg/h）	0.039				/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-36 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.4	19.3	19.6	19.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		27916	27530	28683	28043	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-37 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.5	19.6	19.6	19.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		27537	28123	28683	28114	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-38 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.0	15.0	15.1	15.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		30896	31316	30970	31061	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-39 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.2	15.2	15.4	15.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		29647	30827	31149	30541	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	1.25	2.99	1.30	1.85	10
	排放速率（kg/h）	0.057				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-40 固定污染源废气检测结果表（5 月 9 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.0	15.1	15.4	15.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		30896	30970	31149	31005	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》（HJ/T 67-2001）
氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016）
硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》（HJ 544-2016）
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）
氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》（HJ/T 30-1999）
氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 2007 年 第五篇第四章 十（三）
备注	/

表 3-1 仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-046-10	数字温度表	6801
F-001-13	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
X-015-105	阻容法烟气含湿量多功能检测器	1062D 型
X-016-36	全自动烟气采样器	MH3001
X-015-121	便携式大流量低浓度自动烟尘/气测试仪	海纳 3012D 型
X-060-31	充电便携采气桶	labtm009
X-016-40	全自动烟气采样器	MH3001
X-015-93	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H-C
X-016-39	全自动烟气采样器	MH3001
X-015-11	自动烟尘(气) 测试仪	崂应 3012H
X-016-15	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-016-09	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-015-37	自动烟尘(气) 测试仪	崂应 3012H
X-015-47	自动烟尘(气) 测试仪	崂应 3012H
X-016-38	全自动烟气采样器	MH3001
X-016-37	全自动烟气采样器	MH3001
X-015-12	自动烟尘(气) 测试仪	崂应 3012H
X-016-41	全自动烟气采样器	MH3001
X-015-77	烟气综合分析仪	崂应 3022

表 3-2 仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-016-44	全自动烟气采样器	MH3001
X-015-78	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-015-82	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-016-26	智能双路烟气采样器	崂应 3072
F-001-14	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-010-08	离子色谱仪	883
F-010-06	离子色谱仪	883
F-014-22	离子计	PXSJ-216
X-015-51	自动烟尘(气) 测试仪	崂应 3012H

*****报告结束*****